

## 高真空蒸着装置 RD-1500



高真空蒸着装置RD-1500は金属を成膜するための蒸着装置です。

抵抗加熱電極が6対ありますので、多層膜や同時成膜が可能です。排気系動作は自動。

水晶振動式膜厚計も標準で搭載しております。

### 高真空蒸着装置 RD-1500 仕様

- 到達圧力  $\times 10^{-5}$ Pa台以下※ワーク挿入時・常温時
- 排気速度 大気圧から60分で $2.0 \times 10^{-4}$ Pa※常温・無負荷・脱ガス時
- 真空漏洩量  $1.0 \times 10^{-10}$ Pa $\cdot$ m<sup>3</sup>/sec Heリークデテクター検査
- 真空室径  $\phi 500$ mm $\times$ 625mmH SUS304 電解研磨処理 前扉方式
- 蒸着機構 抵抗加熱方式6対(最大2源同時可能)  
AC10V0~250A  
制御方式:サイリスタ制御  
電流計・可変ボリューム
- 基板形状  $\phi 290$ mm 4インチウエハー4枚設置可能(ご希望形状に対応可能)
- 基板回転 回転数:0~15rpm
- 膜厚計 水晶振動式膜厚計
- 真空排気系 油回転ポンプ:333L/min[50Hz]  
油拡散ポンプ:1100L/sec 水冷バツフル付
- 真空計 広帯域真空計
- 操作方法 排気系全自動(手動操作も可能)
- 制御系 独立制御盤型:タッチパネル/シーケンサー/サイリスタユニット/各種コントローラ
- ユーティリティ 電気:AC200V単相50A  
冷却水:2L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環  
計装エア:0.5MPa以上  
装置本体:950mmW $\times$ 1000mmD $\times$ (1922)mmH  
制御盤:570mmW $\times$ 1000mmD $\times$ (1593)mmH